### METHOD FOR MANUFACTURING SOLAR CELL AND SOLAR CELL

Publication number: JP2001308357

Publication date: 2001-11-02

Inventor: FUKUI ATSUSHI; KIMOTO KEISUKE

Applicant: MITSUI HIGH TEC

Classification: - international:

H01L31/04; H01L31/04; (IPC1-7): H01L31/04

- European:

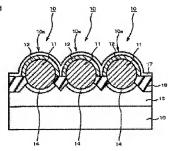
Application number: JP20000121921 20000424

Priority number(s): JP20000121921 20000424

Report a data error here

# Abstract of JP2001308357

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar cell of high quality and high efficiency, capable of solving an electric short-circuit problem completely in the assembly process and produced at high yield. SOLUTION: A plurality of spherical diodes 10a are half buried and fixed in a thermoplastic resin 13 and exposed portions of the spherical diodes 10a. are etched to expose the first conductivity diffusion layer regions 11 inside the spherical diodes 10a, A metal film 14 having good wettability to a conductive paste 15 is selectively formed on the whole or the exposed portions of the first conductivity diffusion layer regions 11. The spherical diodes 10a are released from the fixed state and are placed on a conductive substrate 16 coated with the conductive paste 15. The conductive substrate 16 with the spherical diodes 10a placed thereon is bented to melt the conductive paste 15. The spherical diodes 10a are collected and an insulting layer 18 is formed on the spherical diodes 10a. A transparent conductive film 17 is deposited on the spherical diodes 10a so as to cover the second conductivity diffusion layer region 12 and the insulating layer 18.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Japanese Patent Laid-Open No. 2001-308357

[0015]

The solar cell 10 is produced from a spherical diode 10a by a production method described later. As shown in Figure 2, an n-type diffusion layer region 12 (second conductive diffusion layer region) that forms a pn junction together with a p-type diffusion layer region 11 (first conductive diffusion layer region) is formed into a semicircular shape on an upper outer periphery of the p-type diffusion layer region 11. On a lower outer periphery thereof, a metal film 14 is formed into an arcuate shape, and electrically connected via a conductive paste 15 to a conductive substrate 16 that constitutes a p-type electrode of the solar battery. Further, a transparent conductive film 17 that constitutes an n-type electrode is deposited on the outside of the n-type diffusion layer region 12, and the transparent conductive film 17 and the conductive substrate 16 are electrically insulated by an insulting layer 18.

[0026]

Next, an insulting layer 18 is formed by, for example, sprinkling powdery insulting resin and reflowing, or by pouring liquid insulting resin by potting, then a transparent conductive film (for example, ITO) 17 is deposited thereon by spattering or the like, and the transparent conductive film constitutes an n-type electrode of the solar battery. This state is shown in Figure 5(h). The solar battery is generally as shown in Figure 1.

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

特開2001-308357 (P2001-308357A) (43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

(51) Int. Cl.' HO1L 31/04

(21)出願番号

(22)出所日

織別記号

特願2000-121921(P2000-121921)

平成12年4月24日(2000.4.24)

F I

テーマコード(参考)

H O 1 L 31/04

H 5F051 A

審査請求 未請求 請求項の数6

OL

(全9頁)

(71)出願人 000144038

株式会社三井ハイテック

7

福岡県北九州市八幡西区小嶺2丁目10-1

(72)発明者 福井 淳

福岡県北九州市八幡西区小衛二丁目10番1

号 株式会社三井ハイテック内

(72)発明者 木本 啓介

福岡県北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1

号 株式会社三井ハイテック内

(74)代理人 100099195

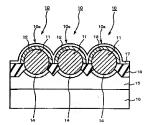
弁理士 宮越 典明

最終質に続く

#### (54) 【発明の名称】太陽電池の製造方法及び太陽電池

# (57) 【要約】

【課題】 アセンブリ工程における電気的な短絡の問題 を抜本的に解消することができ、高品質で歩留まりが良 く、効率のよい太陽電池を得る。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも表面が第1導電型の拡散層領 域を構成する球状基板表面に、pn接合を形成するよう に形成された第2 郷電型の拡散層領域を有する複数の球 状ダイオードを、熱可塑性樹脂内に略半分埋没させ、固 定する工程と、

前記球状ダイオードの熱可塑性樹脂から露出している部 分をエッチングし、前記球状ダイオード内部の前記第1 導電型の拡散層領域を露出させる工程と、

全面若しくは前記第1導電型の拡散層領域の露出部に、 導電性ペーストと濡れ性の良い金属膜を選択的に形成す

前記球状ダイオードを前記固定から開放する工程と、 導電性ペーストを塗布した導電性基板上に、前記球状ダ

イオードを設置する工程と、

前記球状ダイオードを截置した導電性基板をリフロー し、導電性ペーストを溶融する工程と、

前記球状ダイオード同士を寄せ集めて凝集する工程と、 前記球状ダイオード上に、絶縁層を形成する工程と、 前記第2導電型の拡散層領域および前記絶縁層を覆うよ 20

うに透明導電膜を堆積する工程と、を含むことを特徴と する太陽電池の製造方法。

【請求項2】 少なくとも表面が第1導電型の拡散層領 域を構成する球状基板表面に、DN接合を形成するよう に形成された第2導電型の拡散層領域を有する複数の球 状ダイオードを、熱可塑性樹脂内に略半分埋没させ、固 定する工程と、

前記球状ダイオードの熱可塑性樹脂から露出している部 分をエッチングし、前記球状ダイオード内部の前記第1 導電型の拡散層領域を該出させる工程と、

前記熱可塑性樹脂内に略半分埋没させ、固定された状態 の全表而若しくは前記第1 邁重型の拡散層領域の酸出部 に、導電性ペーストと濡れ性の良い金属膜を選択的に形 成する工程と、

前記球状ダイオードを前記固定から開放する工程と、 **導電性ペーストを塗布した導電性基板上に、前記球状ダ** イオードを裁獄する工程と、

前記球状ダイオードを裁置した導電性基板をリフロー し、導電性ペーストを溶融する工程と、

前記球状ダイオード上に、絶縁層を形成する工程と、 前記第2導電型の拡散層領域および前記絶縁層を覆うよ うに透明導電膜を堆積する工程と、を含むことを特徴と する太陽雷池の製造方法。

【請求項3】 請求項1または2に記載の太陽電池の製 造方法において、前記絶縁層を形成する工程は、粉末状 の絶縁性樹脂を前記球状ダイオードトに振り掛けた後。 リフローして、絶縁層を形成することを特徴とする太陽 電池の製造方法。

【請求項4】 請求項1または2に記載の太陽電池の製

絶縁性樹脂を流し込むことにより前記総縁層を形成する ことを特徴とする太陽電池の製造方法。

【請求項5】 シート状の導電性基板上に太陽電池セル が敷き詰められた太陽雷池であって.

前記太陽電池セルは、第1導電型の拡散層領域と、pn 接合を形成する第2導電型拡散層領域とが、前記第1導 電型拡散層領域の外周部の上部に半円状に形成され、 前記第1導電型拡散層領域の外周部の下部に金属膜が円

弧状に形成され、

10 前記導電性ペーストを介して、前記導電性基板と電気的 に接続され、

前記第1 導電型拡散層領域の外側に透明導電膜が堆積さ

該透明導電膜と、前記導電性基板とが絶縁層により管気 的に絶縁されていることを特徴とする太陽電池。

【請求項6】 請求項5に記載の太陽電池であって、隣 り合う太陽電池セル同士が隙間なく凝集して配置されて いることを特徴とする太陽電池。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、太陽電池の製造方 法および太陽電池に係り、特に球状ダイオードを用いた 太陽電池の製造方法および太陽電池に関する。

[00002]

【従来の技術】半導体のpn接合部分には内部貿界が生 じており、これに光を当て、電子正孔対を生成させる と、生成した電子と正孔は内部電界により分離されて、 電子はn側に、正孔はp側に集められ、外部に負荷を接 続するとp側からn側に向けて電流が流れる。この効果 30 を利用し、光エネルギーを電気エネルギーに変換する素

子として太陽電池の実用化が進められている。 【0003】近年、単結品、多結品シリコンなどの直径 1 mm以下の球状の半導体 (Ball Semiconductor) 上に 回路パターンを形成して半導体素子を製造する技術が問 発されている。

【0004】その1つとして、アルミ箔を用いて多数個 の半導体粒子を接続したソーラーアレーの製造方法が提 案されている (特開平6-13633号)。 この方法で は、図10に示すように、n型表皮部とp型内部を有す 40 る半導体粒子207をアルミ箔の開口にアルミ箔201 の両側から突出するように配置し、片側の表皮部209 を除去し、絶縁層221を形成する。次にp型内部21 1の一部およびその上の絶縁層221を除去し、その除 去された領域217に第2アルミ箔219を結合する。 その平坦な領域217が導電部としての第2アルミ箔2 19に対し良好なオーミック接触を提供するようにした ものである。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記半 造方法において、前記絶縁屠を形成する工程は、液状の 50 導体粒子207 (球状ダイオード) にエッチングやグラ

(3)

インディングを施すことにより、表面に形成されている 表皮部209 (n型拡散領域)を一部除去して、p型内 部211 (p型拡散層領域)を露出させ、p型電極とし て第2アルミ箔219 (導電性基板) に接合させてい た。この際、半導体粒子207 (球状ダイオード) が自

転してしまうため、第2アルミ箔219 (導電性基板) にn型拡散領域も一緒に接合され、電気的に短絡してし まい、太陽電池の出力が得られないという不具合が生 じ、大きな問題点となっていた。

であり、アセンブリエ程における雷気的な短絡の問題を 抜本的に解消することができ、高品質で歩留まりの良い 太陽電池の製造方法および太陽電池を提供することを目 的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明の第1は、少なく とも表面が第1将電型の拡散層領域を構成する球状基板 表面に、p n 接合を形成するように形成された第2導電 型の拡散層領域を有する複数の球状ダイオードを、熱可 塑性樹脂内に降半分埋没させ、固定する工程と、前記球 20 状ダイオードの熱可塑性樹脂から露出している部分をエ ッチングし、前記球状ダイオード内部の前記第1導電型 の拡散層領域を露出させる工程と、全面若しくは前記第 1 導電型の拡散層領域の露出部に、導電性ペーストと漂 れ性の良い金属膜を選択的に形成する工程と、前記球状 ダイオードを前記固定から開放する工程と、導電性ペー ストを塗布した導電性基板上に、前記球状ダイオードを 載置する工程と、前記球状ダイオードを載置した導電性 基板をリフローし、導電性ペーストを溶離する工程と、 前記球状ダイオード同士を寄せ集めて凝集する工程と、 前記球状ダイオード上に、絶縁層を形成する工程と、前 記第2導電型の拡散層領域および前記絶縁層を覆うよう に透明導電膜を堆積する工程と、を含むことを特徴とす る。かかる構成によれば、導電性ペースト上でリフロー をかけることにより、導電性ペーストと濡れ性が悪いシ リコンよりも、濡れ性が良い金属膜のみに導電性ペース トが選択的に接合するので、第2導電型の拡散層領域 と、導電性ペーストとが電気的に短絡する不具合が生じ ない。また、リフロー中は、比重の軽い球状ダイオード は浮遊状態にあるので、第2導電型の拡散層領域と、導 40 を特徴とする太陽電池。かかる構成によれば、第2導電 電性ペーストとの間の電気的短絡をさせることなく、容 易に寄せ集めることができ、凝集型の太陽電池がpn両 電極間の電気的短絡を起こすことなく製造できる。

【0008】 本発明の第2は、少なくとも表面が第1導 電型の拡散層領域を構成する球状基板表面に、pn接合 を形成するように形成された第2導電型の拡散層領域を 有する複数の球状ダイオードを、熱可塑性樹脂内に略半 分埋没させ、固定する工程と、前記球状ダイオードの熱 可塑性樹脂から露出している部分をエッチングし、前記 球状ダイオード内部の前記第1導重型の拡散層領域を置 50 る。

出させる工程と、前記熱可塑性樹脂内に略半分類没さ せ、固定された状態の全表面若しくは前記第1導電型の 拡散層領域の露出部に、夢電性ペーストと濡れ性の良い 金属膜を選択的に形成する工程と、前記球状ダイオード を前記固定から開放する工程と、導電性ペーストを塗布 した導電性基板上に、前記球状ダイオードを報置する工 程と、前記球状ダイオードを裁置した導面性基板をリフ ローし、導電性ペーストを溶融する工程と、前記球状ダ イオード上に、絶縁層を形成する工程と、前記第2導電 【0006】本発明は、上記問題点に鑑み成されたもの 10 型の拡散層節域および前記絶縁層を覆うように透明導雷 膜を堆積する工程と、を含むことを特徴とする。かかる 構成によれば、導電性ペースト上でリフローをかけるこ とにより、導電性ペーストと濡れ性が悪いシリコンより も、漏れ性が良い金属膜のみに導電性ペーストが選択的 に接合するので、第2導揮型の拡散層領域と、導電性ペ ーストとが電気的に短絡する不具合が生じない。

【0009】本発明の第3は、請求項1または2に記載 の太陽電池の製造方法において、前記絶縁層を形成する 工程は、粉末状の絶縁性樹脂を前記球状ダイオードトに 振り掛けた後、リフローして、絶縁層を形成することを 特徴とする太陽電池の製造方法。かかる構成によれば、 第2導電型の拡散層領域と、導電性ペーストとの電気的 絶縁を容易に実現できる。

【0010】本発明の第4は、詰求項1または2に記載 の太陽電池の製造方法において、前記絶縁層を形成する 工程は、液状の絶縁性樹脂を流し込むことにより前配絶 縁層を形成することを特徴とする太陽領池の製造方法。 かかる構成によれば、第2導電型の拡散層領域と、導電 性ペーストとの電気的絶縁を容易に実現できる。

30 【0011】本発明の第5は、シート状の導電性基板上 に太陽電池セルが敷き詰められた太陽電池であって、前 記太陽電池セルは、第1導電型の拡散層領域と、pn接 合を形成する第2導電型拡散層領域とが、前記第1導置 型拡散層領域の外周部の上部に半円状に形成され、前記 第1 漢電型拡散層領域の外周部の下部に金属膜が円弧状 に形成され、前記導電性ペーストを介して、前記導電性 基板と電気的に接続され、前記第1導電型拡散層領域の 外側に透明導電膜が堆積され、該透明導電膜と、前記導 電性基板とが絶縁層により電気的に絶縁されていること 型の拡散層領域と、導電性基板とが電気的に短絡する間 題が発生せず、高品質で歩留まりの良い太陽電池を提供 できる。

【0012】本発明の第6は、請求項5に記載の太陽電 池であって、隣り合う太陽電池セル同士が隙間なく凝集 して配置されていることを特徴とする太陽雷池。かかる 構成によれば、第2導電型の拡散層領域と、導電外基板 とが電気的に短絡する問題が発生せず、高品質で歩留ま りが良く、効率のよいセル凝集型の太陽電池を提供でき

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る太陽電池の製 造方法及び太陽電池の実施形態について図面を参照して 詳細に説明する。以下の各実施形鏡において、第1導電 型を p型、第 2 導電型を n型として、説明を行うが、第 1 導電型を n型、第 2 導電型を p型としても同様に製造 できる。また、以下の各実施形態において、p型多結晶 を球状基板とする球状ダイオードを用いたが、p型単結 晶またはp型アモルファスシリコンなどを用いても良

5

【0014】 (第1の実施形態) 第1の実施形態に係る 太陽電池は、図1に全体図を示すように、シート状の導 電性基板16上に太陽電池セル10が敷き詰められてお り、さらに、図2にこの断面模要図を示す。

【0015】太陽電池セル10は、後述する製造方法に よって、球状ダイオード10aから製造されるものであ り、図2に示すように、p型拡散層領域11 (第1導電 型の拡散層領域)とpn接合を形成するn型拡散層領域 12 (第2導電型の拡散層領域)が、p型拡散層領域1 1の外周部の上部に半円状に形成されており、一方、下 20 部には金属膜14が円弧状に形成され、導電性ペースト 15を介して、太陽電池のp型電極となる導電性基板1 6と電気的に接続されている。さらにn型拡散層領域1 2の外側にn型電板となる透明導電膜17が堆積され、 この透明導電膜17と、導電性基板16とが絶縁層18 により電気的に絶縁されているものである。

【0016】次に、具体的な製造方法の一例を以下、説 明する。まず、本発明で用いる球状ダイオード10aの 形成方法の一例について説明する。直径1mmのp型多 結晶シリコン粒を真空中で加熱しつつ落下させ、結晶性 30 の良好なp型多結晶シリコン球(p型拡散層領域)11 を形成し、この表面に、フォスフィンを含むシランなど の混合ガスを用いたCVD法により、n型多結晶シリコ ン層 (n型拡散層領域) 12を形成する。ここでCVD 工程は細いチュープ内でシリコン球を搬送しながら、所 望の反応温度に加熱されたガスを供給排出することによ り、薄膜形成を行うものである。

【0017】なお、この工程は、p型多結晶シリコン粒 を真空中で加熱しつつ落下させながら球状化し、p型多 結晶シリコン球 (p型拡散層領域) 11を形成するとと 40 もに、落下途上で所望のガスと接触させることにより、 n型多結晶シリコン層 (n型拡散層領域) 12を形成す る様にすることも可能である。

【0018】次に、上述の球状ダイオード10aを用い た太陽電池の製造方法を図3~図5を用いて説明する。 図3~図5は、本字節の形態に係る太陽電池を製造する 各工程の概略断面図である。

【0019】まず、図3の(a)に示すように、上記の n型拡散層領域 I 1 の表面に n型拡散層領域 1 2 が形成 半分程度埋没させて固定する。

【0020】次に、図3の(b)に示すように、球状ダ イオード10aの熱可塑性樹脂13から露出している部 分をエッチングして、n型拡散層領域12を取り除き、 p型拡散層領域11を露出させる。

【0021】次に、図3の(c)に示すように、熱可塑 性樹脂13に固定した状態の全表面若しくは、n型の拡 数層領域11の露出部に、導電性ペーストと濡れ性の良 い金属膜 (例えば、Си、Аиなどの金属膜) 14をス 10 パッタリング法などを用いて、コーティングするように して、選択的に形成する。

[0022] 次に、図4の(d) に示すように、球状ダ イオード10aを熱可塑性樹脂13から開放する。

【0023】次に、図4の(e)に示すように、導電性 ペースト15を塗布した銅基板等を用いた薄雷性基板1 6上に、マウンター等を使用して、球状ダイオード10 aを載置する。

【0024】次に、図4の(f)に示すように、球状ダ イオード10aを設置した導電性基板上16をリフロー して、導電性ペースト15を溶融させる。このとき、導 電性ペースト15と濡れ性が悪いシリコンよりも、濡れ 性が良い金属膜のみに導電性ペースト15が選択的に接 合する。つまり、図4の(e)において、球状ダイオー ド10aの金属膜14の位置がそろっていない状態であ るのに対し、リフローすると、図4の(f)のように導 電性ペースト15上に、金属膜14のみが接合するよう に、位置がそろった状態となる。よって、n 型拡散層領 域12と、導電性ペースト15とが電気的に短絡する不 具合が生じない。

【0025】次に、図5の(g)に示すように、導電性 ペースト15を溶融させるための上記のリフロー中に、 球状ダイオード10 a 間土を寄せ集めて、矢印で示す方 向に凝集する。このリフロー中は、比重の軽い球状ダイ オード10aは浮遊状態にあるので、n型拡散層領域1 2と導電性ペースト15との間の電気的短絡をさせるこ となく、容易に寄せ集めることができる。

【0026】次に、例えば、粉末状の絶縁性樹脂を振り 掛け、リフローして絶縁層18を形成するか、若しくは 液状の絶縁性樹脂をポッティングにより流し込むように して絶縁層18を形成し、その後、透明導電膜(例え

ば、ITO) 17をスパッタリング法などにより、薄膜 堆積し、この透明導電膜が太陽電池のn型電極となる。 この状態を、図5の(h)に示す。全体図としては、図 1 に示すような太陽電池となる。

【0027】 (第2の実施形態) 第2の実施形態に係る 太陽電池の製造方法を以下説明する。上記第1の実施形 態と同様にして、図4の(f)の工程まで製造し、この 後、球状ダイオード10aを凝集させずに、次の絶縁層 を形成する工程に進む。すなち、例えば粉末状の絶縁性 された球状ダイオード10aを、熱可塑性樹脂13内に 50 樹脂を振り掛け、リフローして絶縁層18を形成する

か、若しくは液状の絶縁性樹脂をポッティングにより流 し込むようにして絶縁層18を形成し、透明端電膜(例 えば、ITO) 17をスパッタリング法などにより、海 競地類し、この透明導電膜が太陽電池のn型電極となる (図6の断面縁駆傷参数)

【0028】本実施形態は、第1の実施形態の球状ダイ オード10aを凝集しない実施形態であり、本実施形態 の太陽電池の全体図は、図7に示すように隣り合う太陽 電池セルが凝集されていないものであり、その断面概要 図は図6に示すとおりである。

[0029] (第3の実施形態)第3の実施形態に係る 太陽電池の製造方法を以下説明する。予め決められた位 億に101のの球状ダイオードをマウンター等を用いて 収置し、配列を繋えるようにした実施形態である。

【0030】上記第1の実施形態と同様にして、図4の (d) の工利まで製造し、次に、収率性ペーストと濡れ 性の良い動造板、あるいはアルミニウム、SUSなどの 金浜基板上に頻メッキを施した環電性結板16上にソル ダーレジスト19を強布する。次に、球状ダイオード1 0aを設置する予定の場所に当たる領域に、スクリーン 印刷技などを用いて、環電性ペースト15を印刷し、そ の上に、球状ダイオード10aを可シター等を用いて 載置し、図8の(a)に示す状態となる。

[0031] 次に、これをリアローすることにより、球状ダイオード10aの自転によるセルフアラインメント およびXY輸売前のセルフアラインメントが行われ、図 8の(b)に示す状態となる。この図8の(b)は、等 電性ペースト15上に、球状ダイオード10aの金属膜 14のみが接合し、位置がそろった状態である。よっ て、の型板度層領域12と、導電性ペースト15とが電 30 気がに振移する不配合が生じなか。

【0032】次に、例えば、粉末状の絶縁性樹脂を振り 掛け、リフローして絶縁層』8を形成するか、若しくは 破状の絶縁性樹脂をポッティングにより流し込むように して絶縁層』8を形成し、その後、透明薄地機(例え ば、「TO) 17をスパッタリング法などにより、海破 補釈し、この透明神電版が大陽隔部の・理能械となる (図9の証確様要因参照)。全体例としては、な7に示

すような太陽電池となる。

[0033]

【発明の効果】以上詳記したように、本発明に係る太陽

電池の製造方法および大漏電池によれば、装電性ペース ド上でのリフロー効果で、n型拡散層領域と電気的に短 絡することなく、p型電域を取り出すことが、比較的安 値で、容易に出来る。これにより、信頼性の高い電気的 能鉄が得られるので、太陽電池のアセンプリフ程におけ る電気的な短絡の問題を抜か的に解消することができ、 高品質で砂密まりが良く、効率のよい太陽電池を提供で きる。

#### 【図面の簡単な説明】

10 【図1】第1の実施形態に係る太陽電池の全体図である。

【図2】第1の実施形態に係る太陽電池を示す断面概要 図である。

【図3】本発明に係る太陽電池の製造方法の製造工程 (a)~(c)を説明する断面概要図である。

【図4】本発明に係る太陽電池の製造方法の製造工程 (d)~(f)を説明する断面観要図である。

【図5】本発明に係る太陽電池の製造方法の製造工程 (g)、(h)を説明する断面概要図である。

0 a を載置する予定の場所に当たる領域に、スクリーン 20 [図6]第2の実施形態に係る太陽電池を示す断面機要印刷法などを用いて、導電性ペースト15を印刷し、そ 図である。

【図7】第2の実施形態に係る太陽電池の全体図であ

【図8】第3の実施形態に係る太陽電池の製造方法の製造工程を一部を説明する断面概要図(a)、(b)であ

【図9】第3の実施形態に係る太陽電池を示す断面擬要 図である。

【図10】従来例の太陽電池を示す断面概要図である。 (符号の期明)

10 太陽電池セル

10a 球状ダイオード

11 n型拡散層領域(第1導電型の拡散層領域)

12 p型拡散層領域 (第2導電型の拡散層領域)

13 熱可塑性樹脂

1.4 金屋隙

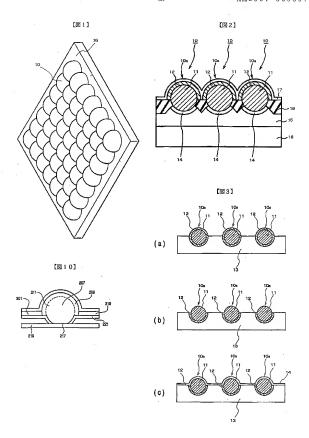
15 募電性ペースト

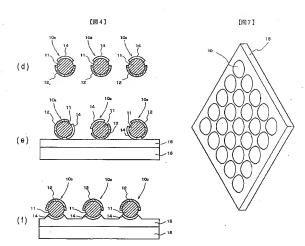
16 導電性基板

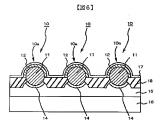
17 透明導電際

18 絶縁層

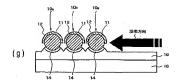
19 ソルダーレジスト

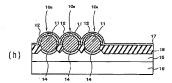




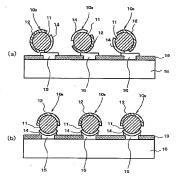


[図5]

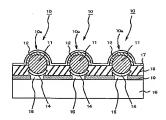




[図8]







# フロントページの続き

F ターム(参考) 5F051 AA02 AA03 AA05 CB04 CB30
DA01 DA03 DA02 FA02 FA06
FA10 FA13 FA15 FA30 GA02
GA05 GA11 GA20